半導体試作ソリューション

ご仕様に合わせ、最適な材料・プロセスを選択。少量からの微細パターン加工に対応します。



シリコン、ガラス、樹脂など多様な材料に対応



スパッタ、蒸着、CVD、メッキなど、常時120種類 以上の材料を保有し、スピーディな対応が可能



イオン注入

イオン注入可能な材料は、60種類以上



コンタクトアライナー、ステッパー、EB描画、 ナノインプリント、3Dパターンなど



エッチング

ドライ(RIE、ICP)、ウェット、犠牲層エッチング

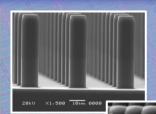


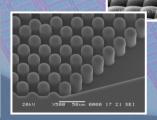
MEMS材料・構造に最適なCMPプロセスを、 スラリーの組成レベルから提案



ウェハ接合

表面活性化、ハイブリッド、陽極、共晶 etc.









https://www.kyodo-inc.co.jp/electronics/

044-852-7575 (電子部)

